PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 07.04.1995

(51)Int.CI.

H01F 1/14 C22C 38/00 H01F 19/04

(21)Application number: 05-198057

(71)Applicant:

HITACHI METALS LTD

(22)Date of filing:

10.08.1993

(72)Inventor:

YOSHIZAWA KATSUTO

BIZEN YOSHIO

NAKAJIMA SUSUMU ARAKAWA SHUNSUKE

(54) PULSE TRANSFORMER MAGNETIC CORE AND PULSE TRANSFORMER

PURPOSE: To provide a pulse transformer magnetic core, consisting of a nano crystal soft magnetic alloy to be used for a small type digital signal transmission system having high-performance and reliability characteristics and temperature characteristics, and a pulse transformer.

CONSTITUTION: The pulse transformer magnetic core is formed using a nano crystal soft magnetic alloy, having the initial relative magnetic permeability of 50000 or higher in -20 to 50° C, as magnetic core material. Accordingly, as a pulse transformer and a pulse transformer magnetic core, consisting of a nano crystal soft magnetic alloy and used for a digital signal transmission system, which is smaller in size than the conventional pulse transformer magnetic core and having high efficiency and excellent reliability characteristics and temperature characteristics, can be provided, their efficiency is substantially high.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-94314

(43)公開日 平成7年(1995)4月7日

(51) Int. Cl. ⁶ 識別記	号 庁内整理番号	FI		技術表示箇所		
H 0 1 F 1/14		•				
C 2 2 C 38/00	i e		•			
H 0 1 F 19/04		* =				
, eq	•	H01F	1/14	Z		
	8123 - 5 E		19/04	U .		
審査請求 未請	求 請求項の数5	OL		(全5頁)		
(21)出願番号 特願平5-1980	57	(71)出願人	000005083	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
(21) [138([]] (30)		(11)山嶼八	日立金属株式会	51 .		
(22)出願日 平成5年(1993)	· 8日10日 -	東京都千代田区丸の内2丁目1番2号				
(22) [1330]	10 10 10	(79\ ₹% ¤9:±¢		NOM2 J 日 I 番 2 号		
		(72)発明者				
	·, ·		the state of the s	ケ尻5200番地日立金属株式		
	· .*	(00) 500 507 44	会社磁性材料研究	先所内		
		(72)発明者				
				ケ尻5200番地日立金属株式		
		`	会社磁性材料研究	究所内		
		(72)発明者	中島 晋			
			埼玉県熊谷市三	ケ尻5200番地日立金属株式		
			会社磁性材料研究	究所内		
	•	(74)代理人	弁理士 大場	充		
	<i>:</i>		er.	最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】パルストランス用磁心ならびにパルストランス

(57)【要約】

【目的】 小型で高性能かつ信頼性特に温度特性に優れたデジタル信号伝送システムに用いられるナノ結晶軟磁性合金からなるパルストランス用磁心ならびにパルストランスを提供する。

【構成】 磁心材料として-20°Cおよび50°Cにおいて比 初透磁率が50000以上であるナノ結晶軟磁性合金を用いたパルストランス用磁心。本発明によれば、従来のパルストランス用磁心より小型で高性能かつ信頼性特に温度特性に優れたデジタル信号伝送システムに用いられるナノ結晶軟磁性合金からなるパルストランス用磁心ならびにパルストランスを提供することができるためその効果は著しいものがある。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 磁心材料として-20°Cおよび50°Cにおいて比初透磁率が50000以上であるナノ結晶軟磁性合金を用いたことを特徴とするパルストランス用磁心。

【請求項2】 磁心材料の角形比が30%以下であることを特徴とする請求項1に記載のパルストランス用磁心。 【請求項3】 ナノ結晶軟磁性合金の平均結晶粒径が2から30mmであることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のパルストランス用磁心。

【請求項4】 ナノ結晶軟磁性合金がFeを主体とする合 10 金であって、Cu, Auから選ばれる少なくとも1種の元素の含有量が0.1以上3at%以下、Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, Wから選ばれる少なくとも一種の元素の含有量が1以上10at%以下、Siの含有量が12at%以上16.5at%未満、B含有量が4at%以上9at%未満の組成であることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のパルストランス用磁心。

【請求項5】 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載のパルストランス用磁心から構成され-20°Cおよび50°Cにおいて20mHを越える10kHzのインダクタンスを有することを特徴とするパルストランス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、デジタル信号伝送システム等に用いられるナノ結晶軟磁性合金からなるパルストランス用磁心ならびにパルストランスに関する。

[0002]

【従来の技術】電子回路の分野では、電子計算機、パル ス通信・測定器のディジタル化等のパルス技術の発展に 伴い、回路素子自体もその波形伝送の観点から高性能の 素子が要求されている。ISDN等のパルス状のディジタル 信号を伝送するシステムに用いられるパルストランス は、波形伝送に主眼が置かれた広帯域トランスである。 従来、これらのパルストランスには、大別して金属磁性 材料とフェライト材料が用いられている。金属材料とし ては、パーマロイ材(Ni-Fe合金)と珪素鋼(Fe-Si合金)が 用いられている。金属材料は低周波特性に優れ飽和磁束 密度が大きいために、パルス幅の広い、印加レベルの高 い用途に使用される。しかし、珪素鋼は透磁率が低く十 分なインダクタンスがとれない問題がある。またパーマ ロイも低周波の透磁率は高いものが得られるが周波数特 性が悪くパルス幅が狭い用途には適さず、また、衝撃に より特性が劣化することや価格が高い問題があるためIS DNのインターフェイス用のパルストランス等には問題が ある。一方、フェライト磁性材料は、金属系材料に比べ て飽和磁束密度が低く、印加レベルの高い場合に問題は あるものの、高周波特性に優れ価格的にも安価であるため め現在パルス幅の狭い前述の用途に最も用いられてい る。しかし、これらの用途に用いられる高透磁率タイプ のフェライト磁性材料の飽和磁束密度は0.5T以下であ

り、透磁率も10000程度しか得られない。このため、バルストランスの動作磁束密度を大きくできず磁心が大きくなる問題や、十分なインダクタンスを得るために断面積を大きくしたり巻線を多くしなければならない問題がある。巻き線が多いことは工数を増大するとともに結合キャパシタンスを増加させ伝送特性を劣化させる。また、フェライト磁性材料は温度特性が悪い問題点がある。高透磁率のCo基アモルファス合金は材料価格が高い点や経時変化が大きく信頼性の点で問題がある。また、特開平2-295101に微結晶鉄ベース合金からなるインターフェース変成器用磁心が記載されている。0.2未満の残留磁気比Br/Bsと20000から50000の範囲の比初透磁率とを有する微結晶鉄ベース合金からなることを特徴としており、小さい体積でかつ少ない巻数のインターフェース用変成器が実現できることが記載されている。

[0003]

20

30

40

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、近年小型化、薄型化、高性能化、高信頼性の要求が益々増加している。使用する環境も多岐に渡るようになってきており周囲の環境がきびし条件でも安定に動作する必要が生じてきている。このような要求に対しては前記磁心では対応が困難な状況になってきている。本発明の課題は従来のパルストランス用磁心より小型高性能でかつ信頼性特に温度特性に優れたデジタル信号伝送システムに用いられるナノ結晶軟磁性合金からなるパルストランス用磁心ならびにパルストランスを提供することである。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するために本発明者らは鋭意検討の結果、磁心材料として-20° Cおよび50° Cにおいて比初透磁率が50000以上であるナノ結晶軟磁性合金を用いた磁心がデジタル信号伝送システムに用いられるパルストランス用磁心として最適であることを見い出し本発明に想到した。ナノ結晶合金としては特公平4-4393に記載されている鉄を主体とした0.1から3at%のCu、0.1at%から30at%のNb, W, Ta, Zr, Hf, Ti及びMo、30at%以下のSiおよび25at%以下のBを含む合金であり、かつSiとBの合計が5から25at%の範囲にある合金が挙げられる。これらの合金の結晶粒径は100nm以下である。特に粒径が2nm以上30nm以下の場合にパルストランスとして波形伝送がより忠実な高性能なものが得られる。

【0005】また、特にFeを主体とする合金であって、Cu, Auから選ばれる少なくとも1種の元素の含有量が0.1以上3at%以下、Ti, 2r, Hf, V, Nb, Ta, Mo, Wから選ばれる少なくとも一種の元素の含有量が1以上10at%以下、Siの含有量が12at%以上16.5at%未満、B含有量が5at%以上9at%未満の組成である合金において-20°Cおよび50°Cにおいて比初透磁率が50000以上が容易に得られ、透磁率のレベル特性が良好で、かつパルストランスとして波形伝送がより忠実な高性能なものが得られる。前記合金中の結

晶は主にbcc相である。bcc相の一部に規則相が含まれて も良い。また前記合金の一部にアモルファス相が含まれ ても良い。また、前記合金には必要に応じてCr, Mn, Al, S n, Zn, Ag, Sc, Y, 白金族元素, Re, 希土類元素, C, Ge, P, Ga, S b, In, Be, As, Mg, Ba, Srからなる群から選ばれる少なくと も1つの元素を含んでも良い。また、不可避不純物とし て酸素、窒素、水素等を含む場合がある。

【0006】磁心材料の角形比が30%以下の場合には動 作磁束密度を大きくでき、高い動作磁束密度まで高パル ス透磁率を維持できるためより一層の磁心の小型化が実 10 現され、より好ましい結果を得ることができる。前記本 発明からなる磁心を用いたパルストランスは従来のパル ストランスに比べ小型の磁心で10kHzにおいて20mHを越 えるインダクタンスを有する温度特性に優れたパルスト ランスを実現できる。このようなパルストランスはISDN 用として好適な性能を示す。

【0007】本発明に係わる磁心は次の工程で製造され る。液体急冷法によりアモルファス合金薄帯を製造した 後これを巻き回す、あるいは積層しトロイダル状にする 工程と、微結晶化のための熱処理を行い-20°Cおよび50° Cにおいて比初透磁率が50000以上になるように調整する 熱処理工程、あるいは、液体急冷法によりアモルファス 合金薄帯を製造した後これを巻き回す、あるいは積層し トロイダル状にする工程と、微結晶化のための熱処理を 行い更に磁場を磁心の磁路と垂直方向に印加し-20°Cお よび50°Cにおいて比初透磁率が50000以上になるように 調整する熱処理工程である。特に磁場中熱処理を併用す ることにより角形比が低くなりより一層の磁心の小型化 や波形伝送が忠実な高性能なパルストランスを実現する ことができる。磁心の磁路と垂直方向に磁界を印加する 30 場合は磁心の高さ方向に印加する場合と径方向に印加す る場合がある。

【0008】液体急冷法は公知の単ロール法や双ロール 法等である。製造する雰囲気は通常大気中であるが、活 性な金属を含む場合は雰囲気中で製造する。板厚が10μ m未満の場合は減圧下で作製した方が表面状態の良好な 薄帯が得られ好ましい結果が得られる。作製されるアモ .ルファス合金薄帯は板厚1μmから100μm程度のもので、 通常作製されるのは2μmから30μm程度の板厚である。 また、薄帯の幅は0.5mmから500mm程度であるが本用途に 40 は25mm以下の幅の薄帯が用いられる場合が多い。薄帯を 積層する場合はあらかじめ薄帯の打ち抜きあるいはフォ トエッチ等を行い閉磁路となるような形に成形してお く。合金薄帯表面の少なくとも片面はSiO2、Al2O3、MgO 等の絶縁物により被覆し層間絶縁を行うことができる。 層間絶縁を行うことにより、より周波数特性の良好なパ ルストランスが得られる。

【0009】熱処理雰囲気はArや窒素等の不活性ガス中 が好ましい。酸素濃度は5%以下がより好ましい結果が得 られる。結晶化のための熱処理は通常結晶化温度以上の 50

温度に昇温することにより行われる。この熱処理は通常 は一定温度に保持する期間があるが、場合によっては一 定に保持する期間がなくても良い。熱処理の際に磁場を 印加する場合は、結晶化の熱処理よりも低い温度で印加 することが50000以上の比初透磁率を得る上で望まし い。結晶化の熱処理は通常は500°Cから580°Cで2時間以 内、磁場中熱処理の温度は300°C以上で前記結晶化の熱 処理より低くかつ結晶化により形成するbcc相のキュリ −温度より低い温度で行われる。このような熱処理が特 に有効なのは合金がFeを主体とする合金であって、Cu, A uから選ばれる少なくとも1種の元素の含有量が0.1以上3 at%以下、Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, Wから選ばれる少なくと も一種の元素の含有量が1以上10at%以下、Siの含有量が 12at%以上16.5at%未満、B含有量が4at%以上9at%未満の 組成である場合である。磁心は絶縁および耐環境性を改 善するためにコアケースに入れたり、周囲をコーティン グする。コアケースに入れる場合は必要に応じてグリー スや緩衝材を入れる場合がある。また、コアケースに入 れる前やコーティング前の磁心はできるだけ占積率が高 い方が望ましく、75%以上が望ましい。より好ましくは8 0%以上である。

[0.010]

20

【実施例】以下本発明を実施例にしたがって説明するが 本発明はこれらに限定されるものではない。

(実施例1) 単ロール法により幅2mm厚さ18μmのFebal. Cu₁Nb_{2.9}Si_{15.3}B_{6.6}(at%)の組成のアモルファス合金薄 帯を作製した。次に、この合金薄帯を外径14mm内径7mm に巻き回しトロイダル磁心を作製し、図1に示す熱処理 パターンで熱処理を行った。X線回折および透過電子顕 微鏡による組織観察の結果、合金は粒径約12nmのbcc構 造の結晶粒を主体とする合金であることが確認された。 次にこの磁心を樹脂製のケースに入れ-20°Cおよび50°C の初比透磁率を直流初磁化曲線より求めた。-20°C初比 透磁率は89600、50°Cの初比透磁率は88900であった。ま た、直流B-Hループは比較的フラットな傾斜した形を示 していた。1kHzにおける実効透磁率μeは-20°Cで8100 0、50°Cで80000であった。次にこの磁心に12ターンの巻 線を2つ行いパルストランスを作製した。10kHzのインダ クタンスは測定電流が12mAの場合-20°Cで32mH、50°Cで3 1mHであった。一方、Mn-Znフェライトからなるパルスト ランスは測定電流が12mAの場合、-20°Cで2mH、50°Cで3m Hであり、本発明磁心より著しく劣っていた。

【0011】(実施例2)表1に示す組成の合金溶湯を 単ロール法により急冷し、幅6.5mm厚さ14μmのアモルフ ァス合金薄帯を作製した。次に、この合金薄帯を外径14 皿内径7㎜に巻き回しトロイダル磁心を作製し、図1に 示す熱処理パターンで熱処理を行った。透過電子顕微鏡 およびX線回折の結果粒径2から30mmの微細結晶粒から なることが確認された。次にこの磁心を樹脂製のケース に入れ-20°Cおよび50°Cの初比透磁率を直流初磁化曲線

より求めた。また、角形比 B_r ・ B_s ⁻¹を測定した。次にこの磁心に21ターンの巻線を2つ行いパルストランスを作製した。 -20° C初比透磁率 μ_1 (-20)、 50° Cの初比透磁率 μ_1 (50)、角形比 B_r ・ B_s ⁻¹、 -20° Cの10kHzのインダクタンスL(-20)、 50° Cの10kHzのインダクタンスL(-20)、 50° Cの10kHzのインダクタンスL(-20)、 -20° Cの10kHzのインダクタンスL(-20)。本発明磁心は従来の磁心よりも同じ巻数で高イン*

*ダクタンスを実現できる。すなわち少ない巻数や小形状で従来の磁心と同等のインダクタンスを実現できる。さらに温度特性にも優れており高性能なパルストランスを実現できることが分かる。

[0012]

【表1】

	超 成 (at%)	μ 1(-20)	μ.(50)	8 c · B s - 1 (X)	L(-20) (mH)	L(50) (nH)
本発明例	Fobel Cul. 1Nb2.8Si15.486.7	72500	71000	12	62	610
	Febal .Cul.iNbs.2Sil2.0B7.3	62800	62000	14	54	53
	Febal .CuZr7 .aTlo.sSi2oB6.3	50100	50200	35	43	43
	Febal Cul. 1Mos. 2SI 14.08e.9	52200	51100	20	45	44
	Febra, Cu, , Ta, , 2Si, s. oBe, s	53400	53200	18	46	46
	Febal Cul.185.25116.387.9	50200	50000	23	43	43
	Fobel .Cul.1Hf2.2Si15.3B5.5	51100	50900	. 25	44	44
	Febel.Cal.1Nbs.2V1Si16.3B6	88000	87000	11	58	58
比較例	Fosa1.Cu1Mb3S113.5B9	35400	81000	8	30	26
	Feb. 1 . Cu 1Nb 5 SI 16 . 5B6	32000	38000	12	27	32
	Fobal, Cui., 1Nb SI 4B12.8	15000	13200	23	18	. 11
	Nn-Znフェライト	4600	8000	20	ž	3

【0013】(実施例3)次に実施例2に記載の磁心に 159-ンの巻線を2つ行いパルストランスを作製し、パルス幅 10μ s、動作磁束密度 Δ Bが1Tにおける実効パルス 30 透磁率 μ pを測定した。得られた結果を表2に示す。特に角形比が30%以下の本発明磁心が高い μ pが得られ優れている。

[0014]

【表2】

[0	0	1	5]	

【発明の効果】本発明によれば、従来のパルストランス 用磁心より小型で高性能かつ信頼性特に温度特性に優れ たデジタル信号伝送システムに用いられるナノ結晶軟磁 性合金からなるパルストランス用磁心ならびにパルスト ランスを提供することができるためその効果は著しいも のがある。

8

【図面の簡単な説明】

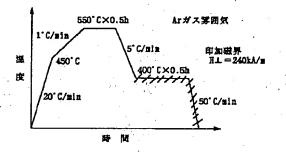
【図1】本発明に係わる熱処理パターンを示した図であ 10 る。

【図2】本発明に係わる熱処理パターンを示した図である。

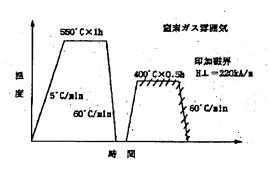
組 成 (at%) μ_{P} Febal .Cu1 .1Nb2 .8Si15 .4B6 .7 20000 Febal .Cul .1Nb3 .2Si 12 .0B7 .3 19500 9000 本 Febal Cul. 12r7.3Tio.5Si12.0B6.3 発 明 Febal .Cul .1No3 .2SI14 .0Be .9 14200 B Febal .Cul .1Ta2 .2Si 15 .0B8 .2 13100 Febal .Cul .1 \$5.2 Sil6.3 B7.9 12400 Febal .Cu1 .1Hf2 .2Si15 .3B5 .5 12200 Febal .Cu1 .1Nb2 .2V1S115 .3B6 21000

20

【図1】



[図2]



フロントページの続き

(72)発明者 荒川 俊介

埼玉県熊谷市三ケ尻5200番地日立金属株式 会社磁性材料研究所内